

## **Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale**

### **- Procedura Aperta per la fornitura di n° 01 Sistema GLOVEBOX integrato ed automatizzato per la deposizione di film sottili in atmosfera**

- Data di pubblicazione: 05/07/2019
- Data di scadenza: 05/08/2019

#### **AVVISO DI CHIARIMENTI n. 1**

- È pervenuto a questo Dipartimento il quesito relativo alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile del Procedimento.

#### ***Quesito n. 1)***

In riferimento al Capitolato Tecnico, pag. 2, Vi chiediamo se è giusta la Vs. descrizione : Holder per substrati con le seguenti caratteristiche 500 x 500 x 500 mm. Ci sembra strano che chiediate un substrato così grande ed anche un quadrato.

#### **Risposta al Quesito n. 1)**

In riferimento al Capitolato Tecnico, pag. 2, la descrizione "Holder per substrati con le seguenti caratteristiche 500 x 500 x 500 mm." va sostituita con "Holder per substrati di diametro 150 mm. Camera di evaporazione di circa 500 \* 500 \* 500 mm."

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Lidia Stea**